

П
Р56

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ISSN 0015-3222

ФИЗИКА И ТЕХНИКА ПОЛУПРОВОДНИКОВ

Март **2013**, том **47**, выпуск **3**



<http://www.ioffe.ru/journals/ftp/>



С.-Петербург
«НАУКА»

Содержание

• Электронные свойства полупроводников

- Багиева Г.З., Абдинова Г.Д., Мустафаев Н.Б., Абдинов Д.Ш.**
Электрические свойства монокристаллов $Pb_{1-x}Mn_xTe$ с избытком теллура 289

- Артамкин А.И., Добровольский А.А., Винокуров А.А., Зломанов В.П., Данилов С.Н., Бельков В.В., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.**

- Фотопроводимость теллурида свинца, легированного ванадием, в терагерцовом спектральном диапазоне 293

- Гусейнов Д.И., Мургузов М.И., Исмаилов Ш.С.**
Особенности самокомпенсации в твердых растворах $Er_xSn_{1-x}Se$ 298

- Мнацаканов Т.Т., Тандоев А.Г., Левинштейн М.Е., Юрков С.Н., Palmour J.W.**
Нарушение нейтральности и возникновение S-образной вольт-амперной характеристики при двойной инжекции в легированных полупроводниках 302

- Поверхность, границы раздела, тонкие пленки**
- Бочаров К.В., Новиков Г.Ф., Hsieh T.Y., Гапанович М.В., Jeng M.J.**
Исследование рекомбинационного процесса на границах кристаллитов в пленках $CuIn_{1-x}Ga_xSe_2$ (CIGS) методом микроволновой фотопроводимости 310

- Gogoi P.**
Thermally deposited Ag-doped CdS transistors with rare-earth oxide Nd_2O_3 as gate dielectric 316
- Катеринчук В.Н., Кудринский З.Р.**
Размерный оптический эффект вnanostructuredированных пленках In_2O_3 320

- Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления**

- Пелещак Р.М., Губа С.К., Кузык О.В., Курило И.В., Данькив О.О.**

- Влияние легирующих изовалентных примесей Bi на формирование однородных когерентно-напряженных квантовых точек InAs в матрице GaAs 324

- Буньков К.В., Головань Л.А., Гончар К.А., Тимошенко В.Ю., Кашкаров П.К., Kulmas M., Sivakov V.**
Зависимость эффективности комбинационного рассеяния света в ансамблях кремниевых нанонитей от длины волны возбуждения 329

- Качурин Г.А., Черкова С.Г., Марин Д.В., Володин В.А., Черков А.Г., Антоненко А.Х., Камаев Г.Н., Скуратов В.А.**

- Действие быстрых тяжелых ионов на многослойные гетероструктуры Si/SiO_2 334

- Аллатов А.В., Вихров С.П., Гришанкина Н.В.**

- Выявление корреляций поверхностного интерфейса пленок $a-Si:H$ методом двумерного флюктуационного анализа 340

- Шиленас А., Пожела Ю., Пожела К., Юцене В., Васильевский И.С., Галиев Г.Б., Пушкирев С.С., Климов Е.А.**

- Максимальная дрейфовая скорость электронов в селективно легированных гетероструктурах $InAlAs/InGaAs/InAlAs$ с введенной InAs-вставкой 348

- Аморфные, стеклообразные, органические полупроводники**

- Кудоярова В.Х., Толмачев В.А., Гущина Е.В.**

- Исследование состава, структуры и оптических свойств пленок $a-Si_{1-x}C_x:H(Er)$, легированных эрбием из комплексного соединения $Er(pd)_3$ 353

- Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники**

- Дроздов К.А., Кочнев В.И., Добровольский А.А., Васильев Р.Б., Бабынина А.В., Румянцева М.Н., Гаськов А.М., Рябова Л.И., Хохлов Д.Р.**

- Фотопроводимость композитных структур на основе пористого SnO_2 , сенсибилизированного нанокристаллами $CdSe$ 360

- Физика полупроводниковых приборов**

- Рахматов А.З., Абдулхаев О.А., Каримов А.В., Ёдгорова Д.М.**

- Особенности работы ограничителя напряжения в импульсном режиме 364

- Карпова С.С., Мошников В.А., Мякин С.В., Колонванина Е.С.**

- Функциональный состав поверхности и сенсорные свойства ZnO , Fe_2O_3 и $ZnFe_2O_4$ 369

- Горбатюк А.В., Гусин Д.В., Иванов Б.В.**

- Теория и моделирование комбинированных механизмов ограничения области безопасной работы полупроводниковых переключателей силовой микроэлектроники 373

- Lanz B., Vainshtein S.N., Lantratov V.M., Kalyuzhnyy N.A., Mintairov S.A., Kostamovaara J.T.**

- Picosecond internal Q-switching mode correlates with laser diode breakdown voltage 383

Содержание

Марков Л.К., Смирнова И.П., Павлюченко А.С., Кукушкин М.В., Васильева Е.Д., Черняков А.Е., Усиков А.С.	
Сравнение свойств светодиодных кристаллов AlGaN вертикальной и флип-чип конструкции с использованием кремния в качестве платы-носителя	386
Унтила Г.Г., Кост Т.Н., Чеботарева А.Б., Тимофеев М.А.	
Оптимизация условий осаждения и отжига пленок легированного фтором оксида индия применительно к кремниевым солнечным элементам	392
• Изготовление, обработка, тестирование материалов и структур	
Palimar Sowmya, Kasturi V. Bangera, Shivakumar G.K.	
Influence of the doping with third group oxides on the properties of zinc oxide thin films	399
Шалеев М.В., Новиков А.В., Юрасов Д.В., Hartmann J.M., Кузнецов О.А., Лобанов Д.Н., Красильник З.Ф.	
Переход от двумерного к трехмерному росту пленки Ge при ее осаждении на релаксированные SiGe/Si(001) буферные слои	404
Шенгурев Д.В., Чалков В.Ю., Денисов С.А., Шенгурев В.Г., Степихова М.В., Дроздов М.Н., Красильник З.Ф.	
Низкотемпературное выращивание эпитаксиальных слоев кремния, солегированных атомами эрбия и кислорода	410
Рожавская М.М., Лундин В.В., Заварин Е.Е., Трошков С.И., Брунков П.Н., Цацульнников А.Ф.	
Влияние газа-носителя, потока trimethylgallия и времени роста на характер селективной эпитаксии GaN	414
• Радиационная стойкость полупроводниковых структур	
Романов В.В., Дементьев П.А., Моисеев К.Д.	
Особенности формирования наноразмерных объектов в системе InSb/InAs методом газофазной эпитаксии из металлоорганических соединений	420
Саченко А.В., Беляев А.Е., Болтовец Н.С., Виноградов А.О., Капитанчук Л.М., Конакова Р.В., Костылев В.П., Кудрик Я.Я., Кладько В.П., Шеремет В.Н.	
К вопросу о механизме формирования контактного сопротивления на шлифованных образцах n-Si	426

Зав. редакцией *Н.Н. Жукова*

Технический редактор *Е. Г. Коленова*

Корректоры *Л.Д. Колосова* и *А.К. Рудзик*

Компьютерный набор и изготовление оригинал-макета

Вычислительный центр ФТИ им. А.Ф. Иоффе РАН

194021 Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26

Лицензия ИД № 02980 от 06 октября 2000 г. Подписано к печати 20.02.13.

Формат 60×90 1/8. Печать офсетная. Усл. печ. л. 18.0. Уч.-изд. л. 17.1.

Тираж 166 экз. (в т. ч. МКО и СНГ — 17 экз.). Тип. зак. № 780. С 35

Санкт-Петербургская издательская фирма «Наука»
199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 1

main@nauka.nw.ru

www.naukaspb.com

Редакция журнала «Физика и техника полупроводников»

Тел. (812) 328-36-12

Первая Академическая типография «Наука»

199034 Санкт-Петербург, 9 линия, 12